**Чжан Хай-Ин. Физико-технологические основы ионно-плазменного травления карбида кремния : автореферат дис. ... кандидата технических наук : 05.27.06 / Гос. электротехн. ун-т.- Санкт-Петербург, 1993.- 12 с.: ил. РГБ ОД, 9 93-2/4047-0**